

Влияние неоднородностей на термоэлектрические свойства сплава 80 мол.% Bi₂Te₃ + 20 мол.% Bi₂Se₃

Goltsman, B.; Komissartšik, M.; Lukjanova, L.; **Paat, Aadu** Физика и техника полупроводников = Physics and technics of semiconductors 1968 / с. 873-876 : ил https://www.ester.ee/record=b1263919*est

Отжиг имплантированных слоев кремния в плазме импульсного газового разряда

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Физика и техника полупроводников = Physics and technics of semiconductors 1981 / с.1232-1234 https://www.ester.ee/record=b1263919*est